

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGEIX EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'QUIPAMENT CIENTÍFIC, COFINANÇAT AMB FONTS FEDER, PER AL SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS I TÈCNICS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

1. OBJECTE DEL PRESENT PLEC:

L'objecte d'aquest Plec és definir les característiques tècniques i funcionals d'equipament científic:

Objecte
<p>Reactive Ion Etching</p> <p>L'objecte del present contracte és el subministrament d'un equip que permeti el decapat controlat de diversos materials dielèctrics, silici, W o altres materials pel Servei de Recursos Científics i Tècnics de la Universitat Rovira i Virgili.</p>

Necessitats administratives:

Necessitats
<p>El sistema és indispensable pel disseny de sistemes nanoestructurats que permetin la fabricació de nanosensors i nanodispositius, tal i com requereixen diversos grups de recerca de la URV.</p> <p>També és necessari per complir amb els objectius de l'ajut per a infraestructures concedit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat amb codi UNRV10-4E-1136.</p>

Codi CPA / CPV
<p>Codi CPA: 31711423-4</p> <p>Codi CPV: 28.99.20</p>

2. PREU DE LA LICITACIÓ:

El preu màxim de licitació, IVA exclòs, serà de 250.869,00 EUR
 Import amb IVA 296.025,42 EUR

Preu màxim licitació (IVA exclòs)	Preu màxim licitació (IVA inclòs)	S'imputarà a les aplicacions pressupostàries següents:	
250.869,00 EUR	296.025,42 EUR	7300215-2029-62302	209.869,00€
		7200004-7021-62302	45.156,42€
		4800333-2011-64062302	15.000,00€
		4800360-2011-64062302	20.000,00€
		4500231-2029-64162302	1.000,00€
		4790035-2012-64362302	5.000,00€

3. TERMINI D'EXECUCIÓ:

El termini màxim per a l'execució del present contracte serà el següent:

Termini màxim execució
2 mesos

4. LLOC DE LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ:

Lloc de lliurament i instal·lació
Servei de Recursos Científics i Tècnics Edifici N2 - Campus Sescelades Avda Països Catalans 26, 43007 Tarragona Telèfon: 977559747 Adreça electrònica: martin.yebras@urv.cat

5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT:

Els requisits mínims que ha de complir són els següents:

- El sistema podrà fer els següents processos:
 - gravat químic de Si, SiO₂, WO₃
 - gravat sec amb plasma
- El sistema permetrà el gravat de mostres de diferents dimensions (oblees, vidres, petits cristalls).
- El sistema disposarà d'un mòdul ICP per millorar el control i la uniformitat dels processos
- El sistema es subministrarà amb una configuració de, com a mínim, 4 gasos de procés.
- El sistema es subministrarà completament instal·lat, amb tots els manuals per al seu correcte us, manteniment i cal·libració.
- Es duran a terme els cursos bàsics necessaris per què el personal del SRCT pugui dur a terme els processos ofertats. Totes les despeses (material, costos de desplaçament, etc...) necessàries per a dur a terme aquesta formació, aniran a càrrec del licitador.

6. CURSOS DE FORMACIÓ:

Cursos de formació

Es duran a terme els cursos bàsics necessaris per a que el personal del SRCiT pugui dur a terme els processos ofertats. Totes les despeses (material , costos de desplaçament , etc...) necessàries per a dur a terme aquesta formació , aniran a càrrec del licitador.

7. GARANTIA:

Garantia mínima

2 anys de garantia in situ que inclogui peces de recanvi, mà d'obra i desplaçament.

8. INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP:

L'equip se subministrarà complet, incloent tots aquells elements necessaris per a la seva correcta instal·lació, posta en marxa i funcionament.

9. CONTRACTE DE MANTENIMENT:

Contracte de manteniment

El contracte de manteniment ha de consistir, com a mínim, en una visita preventiva anual basada en el recanvi de peces i l'emissió del certificat de compliment de les especificacions mínimes de l'equip. O si no, una visita correctiva anual que solucioni el problema i l'emissió del certificat de compliment de les especificacions mínimes de l'equip

El responsable científic
i coordinador del SRCiT

